

# NOMI LOCK™キネマティックミラーホルダー

MHG-MP-NL/MHG-HS-NL

RoHS

高安定型キネマティックミラーホルダーに当社オリジナルのロック機構 (NOMI LOCK™) を搭載しています。  
 NOMI LOCK™は調整ネジのトルクを可変できる新しいタイプのロック機構です。  
 干渉計やレーザ加工装置など、調整後のビーム変位を問題にする用途に最適です。  
 NOMI LOCK™はシグマ光機(株)の登録商標です。(商標登録:5313722)

- キネマティックミラーホルダーは、構造がシンプルで、剛性や安定性に優れ、干渉計やレーザの共振器に用いられています。
- 高安定型ミラーホルダーのMHG-HSと量産型ミラーホルダーのMHG-MPの2タイプあります。
- 高安定型(MHG-HS)はネジのツマミが大きく、2つの作用点の他に支点も調整でき、ミラーの垂直方向の変位も調整することができます。
- 干渉計でNOMI LOCK™を使用しても光軸ズレは干渉縞1本以内に納まります。(ロック操作による個人差があります)
- ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラー側面を3箇所固定する保持方法を採用しています。
- ネジリング等による有効径の制約がないため、反射光や透過光で大きな有効径が得られます。



### ご案内

- ▶ポストスタンド(PST:別売)や先端M6のロッド(RO:別売)に取り付けられます。
- ▶量産型(MHG-MP)はプレートやステージにM4ネジで直接固定することができます。
- ▶量産型(MHG-MP)にはNOMI LOCK™専用スパナが付属されています。

### 注意

- ▶量産型(MHG-MP)の回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。
- ▶高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-\*\*BPRO)をご使用ください。 [参照](#) C016
- ▶ロッド取付用プレート(MHG-\*\*BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。
- ▶ミラー枠の突き当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。

### NOMI LOCK™の調整方法

	操作方法	干渉縞画像 (イメージ)	
①フリー	<p>ロックツマミ 調整ネジ</p>		ロックツマミを緩めると、軽く調整ネジを動かすことができます。
②半ロック			ロックツマミを30度程度締め、調整ネジが重めの状態で、微調整を行います。 (フリーから半ロックするときには干渉縞は大きく動きます。)
③ロック			ロックツマミを最後まで締めこむと調整ツマミが硬くなり動かなくなります。 半ロックからロックにするときは、干渉縞は1本程度しか変化しません。

仕様		主要材質：アルミ(MHG-MP12.7-NLのみシムチユウ) 表面処理：黒アルマイト(MHG-MP12.7-NLのみスーパーブラックロム)								
品番	オプション指定 <sup>※1</sup>	価格 [¥]	適応素子 サイズ [mm]	適応素子 厚さ [mm]	調整軸数	調整範囲		分解能		質量 [kg]
						あたり [°]	回転 [°]	あたり [°/回転]	回転 [°/回転]	
MHG-MP12.7-NL	-	12,000	φ12.7	3~5	3	±3	±3	約0.74	約0.74	0.04
MHG-MP20-NL	UU	8,000	φ20	3~5	2	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-HS20-NL	UU	12,000	φ20	3~5	3	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-MP25-NL	UU	8,000	φ25, φ25.4	3~5	2	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-HS25-NL	UU	12,000	φ25, φ25.4	3~5	3	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-MP30-NL	UU	8,000	φ30	3~5	2	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-HS30-NL	UU	12,000	φ30	3~5	3	±3	±3	約0.39	約0.39	0.12
MHG-MP50-NL	UU	15,000	φ50	5~8	2	±2	±2	約0.26	約0.26	0.24
MHG-MP50.8-NL	UU	15,000	φ50.8	5~8	2	±2	±2	約0.26	約0.26	0.24
MHG-MP80-NL	UU	30,000	φ80	7~12	2	±2	±2	約0.18	約0.18	0.38
MHG-MP100-NL	UU	38,000	φ100, φ101.6	10~15	2	±2	±2	約0.13	約0.13	0.56

※オプション指定については、『ホルダーのロッド・ポストスタンドの変換について』をご参照ください。 [参照](#) C007

アプリケーション  
システム

光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

ミラー

レンズ

プリズム

偏光子

レーザ

ビーム整形

フィルター

シャッター

その他

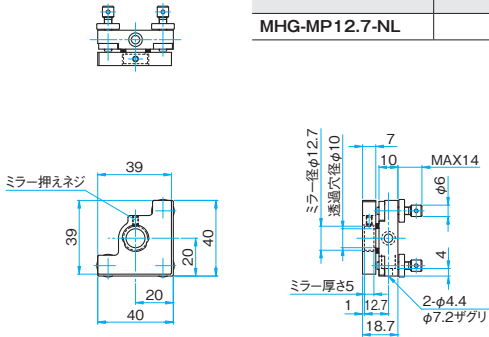
ファイバー



外形図

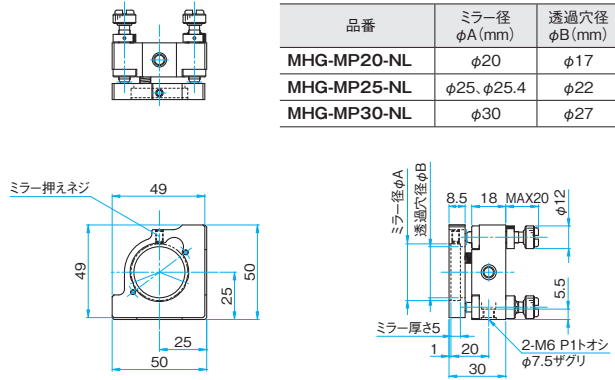
**MHG-MP12.7-NL** 六角穴付ボルト M4×8…1本  
ロックツマミ用スパナ…1本

品番	ミラー径 (mm)
MHG-MP12.7-NL	φ12.7



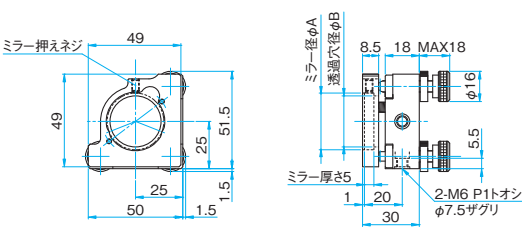
**MHG-MP20-NL/25-NL/30-NL** 六角穴付ボルト M4×10…1本  
ロックツマミ用スパナ…1本

品番	ミラー径 φA (mm)	透過穴径 φB (mm)
MHG-MP20-NL	φ20	φ17
MHG-MP25-NL	φ25, φ25.4	φ22
MHG-MP30-NL	φ30	φ27



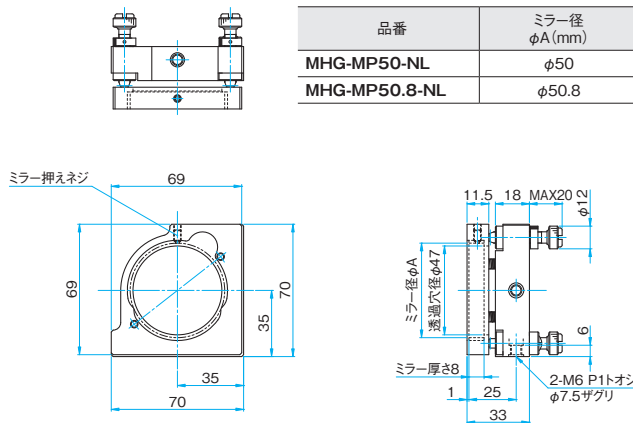
**MHG-HS20-NL/25-NL/30-NL** 六角穴付ボルト M4×10…1本

品番	ミラー径 φA (mm)	透過穴径 φB (mm)
MHG-HS20-NL	φ20	φ17
MHG-HS25-NL	φ25, φ25.4	φ22
MHG-HS30-NL	φ30	φ27



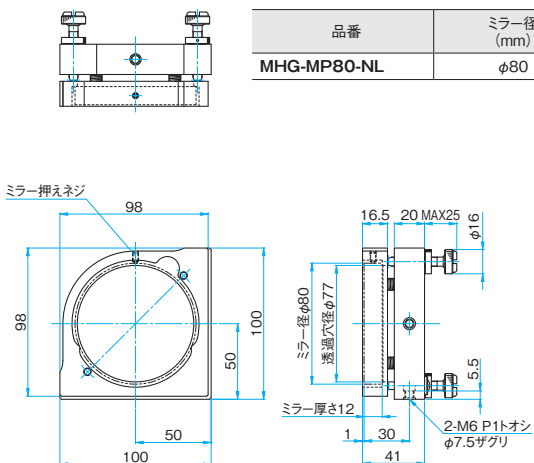
**MHG-MP50-NL/50.8-NL** 六角穴付ボルト M4×10…1本  
ロックツマミ用スパナ…1本

品番	ミラー径 φA (mm)
MHG-MP50-NL	φ50
MHG-MP50.8-NL	φ50.8



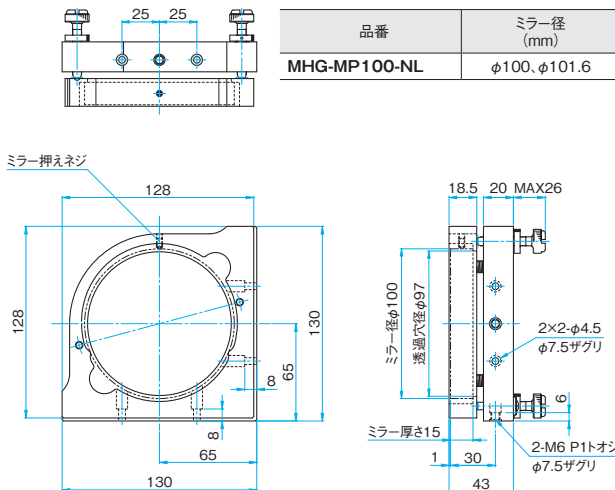
**MHG-MP80-NL** 六角穴付ボルト M4×10…1本  
ロックツマミ用スパナ…1本

品番	ミラー径 (mm)
MHG-MP80-NL	φ80



**MHG-MP100-NL** 六角穴付ボルト M4×12…3本  
ロックツマミ用スパナ…1本

品番	ミラー径 (mm)
MHG-MP100-NL	φ100, φ101.6



アプリケーションシステム

光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

ミラー

レンズ

プリズム

偏光子

レーザ

ビーム整形

フィルター

シャッター

その他

ファイバー